

**„Analiza chemiczna w ochronie zabytków”**

12 XII 2003 (piątek)

9.30- 9.45 POWITANIE

9.45 - 10.15 Jadwiga Łukaszewicz

*"Metody badań stanu zachowania zabytków kamiennych"*

10.15 - 10.45 Piotr Dzierżanowski, Jerzy Kunicki-Goldfinger

*"Zastosowanie mikrosondy elektronowej do badania szkieł historycznych"*

10.45 - 11.15 Joachim Kierzek, Jerzy Kunicki-Goldfinger

*"Rentgenowska analiza fluorescencyjna i wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach historycznych szkieł"*

11.15 – 11.25 PRZERWA

11.25 - 11.50 Ewa Pańczyk, Justyna Olszewska-Świetlik *"Instrumentalna neutronowa analiza aktywacyjna - badania porównawcze bieli ołowiowej w tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny z Muzeum Narodowego w Gdańsku na tle malarstwa polskiego szkoły śląskiej 2 poł. XV wieku"*

11.50 - 12.15 Ewa Pańczyk, Luzja Rowińska, Lech Waliś

*"Badanie proveniencji rzeźby alabastrowej "Madonna Jackowa" z XIV wieku z wykorzystaniem instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej"*

12.15 - 12.35 Barbara Wagner, Ewa Bulska

*"Możliwości i ograniczenia stosowania metody LA ICP MS w badaniach archeometrycznych"*

12.35 - 12.55 PRZERWA

12.55 - 13.25 Andrzej Barański,

*"O podobieństwie degradacji celulozy do wysokotemperaturowej redukcji tlenków żelaza"*

13.25 - 13.50 Józef Dąbrowski

*"Degradacja włókien celulozy, a stopień polimeryzacji celulozy w nich zawartej"*

13.50 - 14.10 Agnieszka Helman-Ważny, Nam-Seok Cho

*"Charakterystyka zabytkowych papierów w obiektach sztuki koreańskiej XVI-XIX wieku"*

14.10 - 14.20 PRZERWA

14.20 - 14.55 Jowita Orska-Gawryś, Izabella Surowiec, Bogdan Szostek, Marek Trojanowicz

*„Badania HPLC nad tkaninami koptyjskimi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie"*

14.55 - 15.20 Anna Potocka

*"Użyteczność metod elektronomikroskopowych (SEM) w procesie konserwacji zabytkowych jedwabii"*

15.20 - 15.45 Magdalena Biesaga, Mateusz Donten, Mikołaj Donten,

*"Wykorzystanie chromatografii cieczowej do analizy zapraw i barwników naturalnych w tkaninach archeologicznych"*

15.45 – 16.00 ZAKOŃCZENIE